На правах рукописи

Hym

Куликов Александр Александрович

,

НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ШНУРОВАНИЯ ТОКА В МОЩНЫХ БИПОЛЯРНЫХ ВЧ И СВЧ ТРАНЗИСТОРАХ

Специальность: 05.11.01 – Приборы и методы измерения по видам измерения (электрические измерения)

ΑΒΤΟΡΕΦΕΡΑΤ

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Ульяновск – 2018

Работа выполнена на базовой кафедре «Радиотехника, опто- и наноэлектроника» Ульяновского государственного технического университета

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Сергеев Вячеслав Андреевич

Официальные оппоненты: Мещеряков Сергей Александрович, доктор технических наук, начальник лаборатории ФАУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы технического и экспортного контроля» (г. Воронеж)

Новиков Сергей Геннадьевич, кандидат технических наук, доцент, начальник лаборатории твердотельной электроники Научно-исследовательского технологического института им. С.П. Капицы Ульяновского государственного университета

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный технический университет»

Защита состоится <u>«28» декабря</u> 2018 г. в <u>12</u> часов <u>00</u> минут на заседании диссертационного совета Д 212.277.01 при Ульяновском государственном техническом университете по адресу: 432027, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, 32 (ауд. 211, Главный корпус).

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ульяновского государственного технического университета. Также диссертация и автореферат размещены в Internet на сайте УлГТУ - http://www.ulstu.ru/

Автореферат разослан «____» ____ 2018 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, доктор технических наук, профессор Смирнов Виталий Иванович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Мощные биполярные и гетеробиполярные ВЧ и СВЧ транзисторы (МБТ) до настоящего времени наряду с мощными полевыми транзисторами широко используются в современных устройствах связи и инфокоммуникаций различного применения. МБТ относятся к классу наименее надежных полупроводниковых приборов, поскольку работают, как правило, в жестких электрических режимах, близких к предельным, при большом уровне рассеиваемой мощности. Предельные характеристики и надежность работы МБТ в этих режимах во многом определяются эффектами неоднородного и неустойчивого распределения плотности тока, мощности и температуры в приборных структурах.

Хорошо известно, что в результате действия положительной тепловой обратной связи электрический ток в структуре МБТ стягивается в узкий шнур и в кристалле МБТ образуется «горячее пятно» (ГП). Образование в структуре МБТ «горячего пятна» заканчивается, зачастую, тепловым пробоем и катастрофическим отказом прибора. Даже при отсутствии необратимых разрушений сильный перегрев локальной области структуры сопровождается большими термодеформациями, ростом числа дислокаций и микротрещин в полупроводнике, и ускорением деградации МБТ. Значения коллекторного тока и напряжения, соответствующих началу процесса локализации тока в МБТ, определяет одну из границ области безопасной работы (ОБР) транзистора. Выход режимов работы МБТ за пределы этой границы даже на короткое время крайне не желателен. Определение этой границы ОБР представляет важную и довольно сложную задачу.

Модели тепловой неустойчивости в структурах МБТ развиты в работах В.Л. Аронова, Б.С. Кернера, В.Ф. Синкевича, Б.К. Петрова, D'Alessandro, D. Navon, D.L. Blackburn, F.F. Oettinger. В большинстве работ рассматриваются модели бездефектных МБТ. Вместе с тем известно, что различные дефекты структуры и конструкции прибора приводят к снижению устойчивости МБТ к шнурованию тока и информативным параметром дефектности МБТ является напряжение шнурования тока.

Методы измерения тепловой границы ОБР МБТ развиты в работах Я.А. Федотова, В.Ф. Синкевича, В.М. Бойздренко, Н.А. Рабодзея, В.А. Гусева, В.А. Сергеева и др. Существующие методы имеют ограниченную чувствительность и позволяют регистрировать информативные сигналы, свидетельствующие о локализации тока в приборной структуре, только при образовании ГП. В результате, МБТ попадают в запредельные электрические режимы, что приводит к появлению дефектов в приборных структурах и ограничивает ресурс приборов. В связи с этим актуальной задачей является разработка неразрушающих методов и средств измерения напряжения шнурования тока в структурах МБТ.

Цель и задачи исследования – повышение чувствительности и точности неразрушающих методов и средств измерения напряжения шнурования тока мощных биполярных ВЧ и СВЧ транзисторов и их автоматизация без введения приборов в критический режим работы с образованием «горячего пятна».

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Численное моделирование теплоэлектрических процессов в МБТ с дефектами теплофизической и электрофизической природы.

2. Анализ теплоэлектрических процессов в структурах МБТ на основе двухсекционной модели МБТ с макродефектами и определение влияния дефектов на вольт-амперные характеристики и малосигнальные параметры МБТ.

3. Разработка способов, алгоритмов и автоматизированных устройств измерения напряжения шнурования тока МБТ по зависимости коэффициента внутренней обратной

связи по напряжению от коллекторного напряжения без введения приборов в режим «горячего пятна».

4. Разработка экспериментальной установки для апробации и исследования метрологических характеристик разработанных способов на образцах серийных мощных ВЧ и СВЧ транзисторов.

5. Исследование зависимостей напряжения шнурования тока от тока и температуры на представительных выборках МБТ и оценка характеристик выборочных распределений МБТ по теплоэлектрическим параметрам.

6. Исследование влияние тепловых параметров и параметров тепловой неустойчивости токораспределения в структуре МБТ на характеристики транзисторных усилительных каскадов на их основе.

Методы исследований. При выполнении диссертационного исследования использовались методы физики полупроводниковых приборов, теории сигналов и цепей, оценки погрешностей, теории вероятности и математической статистики, а также методы математического моделирования с применением ЭВМ.

Научная новизна

1. На основе развитой дискретной двухэлементной теплоэлектрической модели МБТ с дефектами тепловой и электрофизической природы показано, что характер и крутизна зависимости малосигнального коэффициента h_{216} внутренней обратной связи МБТ в схеме с общей базой от коллекторного напряжения $U_{\rm K5}$ определяется типом и размером дефекта; при этом, чем больше дефект, тем больше крутизна зависимости $h_{216}(U_{\rm K5})$ на ее начальном участке.

2. Разработаны новый способ и устройство измерения напряжения шнурования тока в МБТ при заданном эмиттерном токе по значениям малосигнального коэффициента *h*₂₁₆ внутренней обратной связи, измеренным при трех значениях коллекторного напряжения до образования «горячего пятна» в приборной структуре.

3. Разработаны новый способ и устройство определения напряжения шнурования тока в МБТ при заданном эмиттерном токе по значениям коллекторного напряжения, измеренным при двух заданных значениях коэффициентов превышения характеристики $\tilde{U}_{35}(U_{\rm K})$ ее начального уровня до образования «горячего пятна» в приборной структуре.

4. Впервые получены экспериментальные зависимости напряжения шнурования тока МБТ нескольких типов от температуры корпуса в диапазоне температур от -60 °C до +90 °C, и установлено, что эта зависимость имеет немонотонный характер и достигает минимального значения при некоторой температуре корпуса МБТ в указанном диапазоне температур.

5. Показано, что эффекты неоднородного и неустойчивого токораспределения в структурах МБТ приводят к резкому увеличению нелинейности (амплитуды второй гармоники) транзисторных усилителях мощности класса А при приближении рабочей точки к границе ОБР.

Практическая ценность и реализация результатов работы

Разработанные способы и автоматизированные устройства для измерения напряжения шнурования тока в мощных биполярных ВЧ и СВЧ транзисторах могут быть использованы для технологического и выходного контроля качества продукции на предприятияхпроизводителях МБТ, а также на входном контроле предприятий-производителей РЭА с использованием МБТ.

Модернизированная установка УИТП-1М для измерения теплоэлектрических характеристик мощных биполярных транзисторов используется на АО «НПП «Завод «Искра» для выборочного контроля качества выпускаемых МБТ. Разработанные в рамках диссертационного исследования способы измерения напряжения шнурования тока в мощных биполярных ВЧ и СВЧ транзисторах проходят экспериментальную апробацию в УФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН.

Результаты диссертационной работы частично использованы при выполнении проекта «Система мониторинга необслуживаемых телевизионных передатчиков» по Программе УМНИК-2009 и используются проекта «Диагностика качества мощных СВЧ транзисторов по тепловым характеристикам» по гранту РФФИ №18-7321686.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на: Международной научно-технической конференции «Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения» – ИНТЕРМАТИК (г. Москва, 2014–2017 гг.); Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы развития радиотехнических и инфокоммуникационных систем» – РАДИОИНФОКОМ (г. Москва, 2017 г.), Всероссийской молодежной НТК «Наноэлектроника, нанофотоника и нелинейная физика» (г. Саратов, 2012 г., 2015г.), Всероссийской молодежной научной школе-семинаре «Актуальные проблемы физической и функциональной электроники» (Ульяновск, 2012–2017 гг.); Всероссийской НТК «Современные проблемы проектирования и эксплуатации радиотехнических систем» (Ульяновск, 2016 г.).

На защиту выносятся:

1. Двухэлементная теплоэлектрическая модель токораспределения в структурах мощных ВЧ и СВЧ биполярных транзисторов с дефектами различной физической природы и формулы для расчета напряжения шнурования тока МБТ по зависимости малосигнального коэффициента *h*₂₁₆ внутренней обратной связи МБТ от коллекторного напряжения.

2. Способ и устройство для измерения напряжения шнурования тока в мощных биполярных ВЧ и СВЧ транзисторах по значениям малосигнального коэффициента внутренней обратной связи, измеренным при трех значениях коллекторного напряжения до образования «горячего пятна» в приборной структуре.

3. Способ и устройство измерения напряжения шнурования тока в мощных биполярных ВЧ и СВЧ транзисторах по значениям коллекторного напряжения, измеренным при трех заданных уровнях малосигнального коэффициента внутренней обратной связи по напряжению до образования «горячего пятна» в приборной структуре.

4. Расчетные формулы для оценки методической погрешности измерения напряжения шнурования тока способами, указанными в п.2 и п.3.

5. Зависимости напряжения шнурования тока МБТ от температуры в диапазоне до – 60 °С до 90 °С, имеющие немонотонный характер и позволяющие оценить изменение границы ОБР в рабочем диапазоне температур.

6. Зависимости коэффициента гармоник транзисторных усилительных каскадов от теплоэлектрических параметров МБТ.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 30 научных работ, включая 6 статей в изданиях из Перечня ВАК (в том числе 2 статьи в журналах, индексируемых в Scopus) и 2 патента РФ на изобретения.

Личный вклад автора. Основные научные результаты получены автором лично и в соавторстве с научным руководителем. Реализация ряда прикладных разработок и экспериментов осуществлялась с участием сотрудников и студентов кафедр «Радиотехника» и «Радиотехника, опто- и наноэлектроника» УлГТУ. Внедрение результатов исследований проводились при личном участии автора.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка, включающего 132 наименования, 9 приложений. Общий объем диссертации составляет 135 страниц и содержит 10 таблиц и 64 рисунка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель и задачи исследования, научная новизна результатов работы и положения, выносимые на защиту.

В первой главе рассмотрены особенности топологии, конструкции и условий эксплуатации мощных биполярных ВЧ и СВЧ транзисторов, методы и средства контроля параметров их предельных режимов работы, показаны недостатки методов и средств измерения напряжения шнурования тока, сформулированы задачи исследования.

Основными регулярными причинами локализации тока в структуре МБТ являются оттеснение тока к периферии эмиттера из-за падения напряжения на сопротивлении базы и неоднородность тока, обусловленная падением напряжения на сопротивлении дорожек металлизации эмиттера и базы. К случайным факторам, снижающим устойчивость МБТ к локализации тока, относятся разброс сопротивлений омических контактов эмиттера и базы, локальные отклонения величины теплового сопротивления переход-корпус из-за дефектов напайки кристалла, дефекты в области *p*-*n*-переходов (дислокации, скопление примесей и т.д.), неоднородность удельного сопротивления и толщины полупроводниковых слоев и др.

В известном способе по авторскому свидетельству №983596 СССР напряжение $U_{KЛ}$ шнурования тока в МБТ определяется по скачку или излому на зависимости $U_{ЭБ}(t)$ при постоянном эмиттерном токе и линейно нарастающем напряжении U_K на коллекторном переходе. Серьезный недостаток данного способа – разрушающее воздействие, которому подвергается контролируемый МБТ, попадая в режим «горячего пятна».

В работах Гусева В.А. в качестве критерия наступления локализации тока предложено использовать ток индуцированного канала, образующегося в локальной области структуры при подаче в транзистор последовательности импульсов тока нарастающей амплитуды. Способ позволяет обнаруживать более ранние стадии локализации тока, чем при использовании других косвенных параметров, и тем самым исключить катастрофические отказы испытуемых транзисторов. Однако наличие тока канала даже в несколько миллиампер есть результат разогрева области локализации до температуры собственной проводимости (для кремниевых приборов ~250 °C), следовательно, сопровождается циклическими термомеханическими напряжениями.

Во второй главе диссертации представлен аналитическая модель и компьютерный расчет токораспределения в симметричных структурах МБТ с дефектами различной физической природы и разработанные на основе этой модели способы и устройства для неразрушающего измерения напряжения шнурования тока в МБТ.

Теплоэлектрическая модель МБТ с симметричной геометрией активной области представляется в виде двух параллельно соединенных транзисторов (рис.1, *a*).



Рис.1. Электрическая (а) и тепловая (б) модель МБТ с симметричной структурой

Мощность, рассеиваемая *i*-м транзистором в активном режиме, определяется выражением $P_i = U_K I_i$, где коллекторное напряжение U_K полагается одинаковым для обоих транзисторов, а токи $I_{1,2}$ через транзисторы являются функциями температуры:

$$I_i = \left(S_0 A_i / 2\right) \exp\left[-\left(E_g - eU_{\text{B}} + er_{ni}I_i\right) / kT_{ni}\right],\tag{1}$$

где S_0 – полная площадь структуры; A_i – слабо зависящие от температуры инжекционные параметры; $U_{\Im E}$ – напряжение между эмиттером и базой БТ; $r_{ni} = r_{\Im i} + r_{Ei} / B_{CTi}$ – входное сопротивление *i*-го транзистора в схеме с общей базой (ОБ); E_g – ширина запрещенной зоны полупроводника; k – постоянная Больцмана; e – заряд электрона; B_{CTi} – коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (ОЭ).

Температуры переходов T_{ni} при заданной температуре корпуса T_{κ} определяются тепловыми сопротивлениями частей структуры (рис.1, δ):

$$\Delta T_{ni} \equiv T_{ni} - T_{\rm K} = P_i R_{Ti} - (-1)^i R_{Ti} (R_{T2} P_2 - R_{T1} P_1) / (R_{T1} + R_{T2} + R_{T\rm CB}) .$$
(2)

Дефектность МБТ можно свести к различию входных сопротивлений r_{ni} , тепловых сопротивлений R_{Ti} и инжекционных параметров A_i . Причиной различия входных сопротивлений может быть технологический разброс последовательных ограничительных сопротивлений в цепи эмиттера или степени легирования активной и пассивной базы. Различие тепловых сопротивлений определяется наличием дефектов (непропаев или посторонних включений) в контактном слое между кристаллом и кристаллодержателем. Для определенности бездефектным будем считать второй транзистор и обозначим $R_{T2} = R_{T0}$; $\Delta R_T = R_{T1} - R_{T0}$ и $r_{n2} = r_{n0}$; $\Delta r_n = r_{n1} - r_{n0}$.

При заданном полном токе $I_1 + I_2 = I_0 = \text{const}$ токи I_1 и I_2 можно выразить через их отклонение $\delta = (I_1 - I_2)/I_0$ от среднего значения: $I_1 = I_0(1+\delta)/2$; $I_2 = I_0(1-\delta)/2$. В случае малых дефектов выражения (2) в линейном приближении преобразуются к виду

$$\Delta T_{n1,2} = \Delta \overline{T} \pm \Delta \overline{T} , \qquad (3)$$

где $\Delta \overline{T} = \Delta T_0(1+\eta)$ – приращение средней температуры структуры; $\Delta \widetilde{T} = \Delta T_0(1-2a)(\delta+\eta)$ – отклонение температуры частей структуры от средней; $\Delta T_0 = R_{T0}U_{\rm K}I_0/2$, $\eta = \Delta R_T/2R_{T0}$, параметр $a = R_{T0}/(R_{T1} + R_{T2} + R_{TCB})$ определяет степень тепловой связи между частями структуры: при слабой связи $R_{TCB} \rightarrow \infty$ и $a \rightarrow 0$.

Поскольку $\Delta \widetilde{T} << T_{\rm K}$, то выражения для токов (1) можно записать в виде

$$I_{1} = \frac{I_{0}}{2} (1+\delta) \approx (S_{0}A_{1}/2) \exp\left[-\varepsilon - v_{n0}\delta - \varDelta v_{n} + \varepsilon \left(\varDelta \widetilde{T}/T_{\kappa}\right)\right]; \quad (4a)$$

$$I_{2} \equiv \frac{I_{0}}{2} (1 - \delta) \approx (S_{0}A_{2}/2) \exp\left[-\varepsilon + v_{n0}\delta - \varepsilon \left(\varDelta \widetilde{T}/T_{\kappa}\right)\right], \tag{46}$$

где $\varepsilon = v_{n0} + \left[\left(E_g / e \right) - U_{\Im \mathrm{b}} \right] / \varphi_{\overline{T}}$; $\varphi_{\overline{T}} = k \overline{T}_n / e$ - тепловой потенциал при средней температуре структуры $\overline{T}_n = T_{\mathrm{K}} + \Delta \overline{T}$; k – постоянная Больцмана; $v_{n0} = r_{n0} I_0 / 2 \varphi_{\overline{T}}$; $\Delta v_n = \Delta r_n I_0 / 2 \varphi_{\overline{T}}$. Разделив (4a) на (4б), получим уравнение, связывающее величину разбаланса токов с параметрами структуры и дефектов:

$$\frac{(1+\delta)}{(1-\delta)} = \frac{A_1}{A_2} \exp\left[\varepsilon \left(\Delta \widetilde{T}/T_{\rm K}\right) - 2\nu_{n0}\delta - \Delta\nu_n\right].$$
(5)

Логарифмируя обе части (5) и ограничиваясь линейным приближением, получим

$$\delta = \frac{\varepsilon I_0 U_{\rm K} (1 - 2a) (\Delta R_T / 2) - \Delta v_n + \ln(A_1 / A_2)}{2 [1 - \varepsilon U_{\rm K} I_0 (R_{T0} / 2) (1 - 2a) + v_{n0}]}.$$
(6)

Из (6) следует, что относительная величина разбаланса токов прямо пропорциональна величине дефекта и растет с увеличением коллекторного напряжения U_{κ} .

Расчетные зависимости разности токов от коллекторного напряжения, полученные в программе Workbench, дополненной блоком расчета температуры переходов частей структуры, для двух указанных выше типов дефектов, представлены на рис. 2.



Рис. 2. Зависимость от $U_{\rm K}$ разности токов через симметричные части структуры с дефектами: *a* – разность тепловых сопротивлений ΔR_T ; δ – разность сопротивлений эмиттера $\Delta r_{\mathcal{F}}$

При этом крутизна этих зависимостей практически линейно растет с ростом величины дефектов (рис. 3).



Рис. 3. Зависимость крутизны характеристик $\Delta I(U_K)$ от величины дефекта при заданном U_K : а – разность тепловых сопротивлений ΔR_T ; б – разность сопротивлений эмиттера Δr_3

В расчетах использованы электрические параметры, соответствующие паспортным данным кремниевых ВЧ транзисторов типа КТ803А: $B_{\rm cr}$ =20, $r_{\rm E1} = r_{\rm E2}$ =1,0 Ом, $r_{\rm Э0}$ =0,1 Ом, R_{T0} =1,0 К/Вт, I_0 =1,0 А, $U_{\rm ЭE}$ = 0,7 В, $T_{\rm K}$ = 300 К и $R_{T\rm cB} = \infty$.

Выражение для относительного разбаланса токов $\delta = (I_1 - I_2)/I_0$, обусловленного наличием дефектов и тепловой обратной связью, можно представить в виде:

$$\delta = \frac{(1 + v_{n0})(U_{\rm K}/U_{\rm K\Pi})(\Delta R_T/R_{T0}) - \Delta v_n + \ln(A_1/A_2)}{2(1 + v_{n0})[1 - (U_{\rm K}/U_{\rm K\Pi})]},$$
(7)

где $U_{K\Pi} = 2T_{\kappa}(1+\nu_{n0})/\epsilon I_0 R_{T0}(1-2a)$ – такое коллекторное напряжение, при котором весь ток локализуется в дефектной части структуры.

Перераспределение тока в структуре при изменении коллекторного напряжения имеет тепловую природу и проявляется в изменении напряжения $U_{\text{ЭБ}}$, которое одинаково для обеих частей транзисторной структуры:

$$U_{\Im \mathsf{b}} = (E_g/e) - \varphi_{T_{\mathsf{K}}} \{ (1 + \Delta T_{n1}/T_{\mathsf{K}}) \ln [2S_0 A_1 (1 + \delta)/I_0] + (\nu_{n1})(1 + \delta) \},$$
(8)

где $\varphi_{T_{\kappa}} = (kT_{\kappa}/e)$ – тепловой потенциал при температуре корпуса T_{κ} , а $v_{n1} = v_{n0} + \Delta v_n$.

Дифференцируя (8) по U_{κ} в наиболее опасном случае отсутствия тепловой связи между частями структуры ($a \rightarrow 0$) для тепловой составляющей коэффициента внутренней обратной связи по напряжению получим

$$h_{12\mathrm{E}}^{T} = h_{12\mathrm{E}2}^{T} \left[1 + 2\eta + \delta + (U_{\mathrm{K}} - U_{r}) \frac{d\delta}{dU_{\mathrm{K}}} \right], \tag{9}$$

где $h_{12b0}^{T} = -\varphi_{T_{K}} \left(\ln \frac{2S_{0}A_{0}}{I_{0}} \right) \frac{R_{T0}I_{0}}{2T_{K}} -$ тепловая составляющая коэффициента внутренней обратной связи по напряжению в бездефектной структуре, т.е. при $\eta = 0$, $\delta = 0$, а через

 U_r обозначена величина $v_{n1}\varphi_{T_{\rm K}}/h_{12{\rm E}2}^T$.

Для анализа зависимостей h_{125}^T от коллекторного напряжения в приборах с дефектами запишем выражение для производной $d\delta/dU_{\rm K}$ из (7) в общем виде:

$$\frac{d\delta}{dU_{\rm K}} = \frac{(1+v_{n0})(\Delta R_T/R_{T0}) - \Delta v_n + \ln(A_1/A_2)}{2(1+v_{n0})[1-(U_{\rm K}/U_{\rm KR})]^2 U_{\rm KR}}.$$
(10)

Анализ (9) проведем для наиболее важных частных случаев.

Случай 1. Транзистор с теплофизическим дефектом; $A_1 = A_2$ и $\Delta r_n = 0$, $\Delta R_T > 0$. Подставляя в (9) выражения (7) и (10) для δ и $d\delta/dU_K$ соответственно, получим:

$$h_{12\mathrm{F}}^{T} = h_{12\mathrm{F}2}^{T} \cdot \left[1 + \left(1 + \frac{1 - (U_{r}/U_{\mathrm{K}\mathrm{J}})}{[1 - (U_{\mathrm{K}}/U_{\mathrm{K}\mathrm{J}})]^{2}} \right) \eta \right], \tag{11}$$

откуда следует, что h_{125}^T суперлинейно растет с увеличением $U_{\rm K}$.

Случай 2. Транзистор с электрофизическим дефектом, обусловленным различием входных сопротивлений $A_1 = A_2$ и $\Delta R_T = 0$, $\Delta r_n > 0$. В этом случае после подстановки в (9) выражений для δ и $d\delta/dU_{\kappa}$ получим:

$$h_{12\mathrm{E}}^{T} = h_{12\mathrm{E}2}^{T} \cdot \left[1 + \left(\frac{1 - (U_{r}/U_{\mathrm{K}\mathrm{J}})}{\left[1 - (U_{\mathrm{K}}/U_{\mathrm{K}\mathrm{J}}) \right]^{2}} \right) \frac{|\Delta v_{n}|}{2(1 + v_{n0})} \right].$$
(12)

Характер зависимости $h_{125}^{T}(U_{\rm K})$ в этом случае подобен характеру зависимости при теплофизическом дефекте, но из-за отсутствия 1 в круглых скобках (12) суперлинейный характер зависимости $h_{125}^{T}(U_{\rm K})$ будет наблюдаться при меньших $U_{\rm K}$.

Расчетные зависимости $h_{125}^T(U_K)$ для рассмотренных дефектов приведены на рис. 4.

Для более точной оценки напряжения шнурования тока при приближении коллекторного напряжения к $U_{\rm KN}$ необходимо учитывать нелинейные члены в зависимостях (4).

Крутизна зависимости $h_{12\text{Б}}^{\text{T}}(U_{\text{K}})$ определяется типом и величиной дефектов в структуре и конструкции прибора и является информативной характеристикой.

На основе рассмотренной выше модели разработаны способы и устройства измерения напряжения шнурования тока в МБТ по крутизне зависимости $h_{125}^T(U_K)$. Измерение $h_{125}^T(U_K)$ сводится к измерению амплитуды \tilde{U}_{35} переменной составляющей напряжения на эмиттере МБТ при наложении на коллекторное напряжение низкочастотной гармонической составляющей амплитудой 1 В.



Рис. 4. Расчетные зависимости $h_{125}^T(U_K)$ транзистора с теплофизическим (сплошные линии) и электрофизическим (штриховые линии) дефектами при $U_{KII} = 60$ В, $(U_r/U_{KII}) = 0,2$ и различных

размерах дефектов:
$$1 - \frac{|\Delta v_n|}{2(1+v_{n0})} = \eta = 0,1; 2 - \frac{|\Delta v_n|}{2(1+v_{n0})} = \eta = 0,2; 3 - \frac{|\Delta v_n|}{2(1+v_{n0})} = \eta = 0,3$$

В способе измерения $U_{\rm KЛ}$ по патенту №2537519 РФ контролируемый МБТ включается по схеме с общей базой, задается постоянный эмиттерный ток, на коллектор подается сумма линейно нарастающего напряжения, не превышающего предельно допустимого значения $U_{\rm Kmax}$ для данного типа МБТ при заданном токе, и низкочастотного синусоидального напряжения амплитуды 1 В, измеряется амплитуда $\tilde{U}_{\rm ЭБ}$ переменной составляющей напряжения на эмиттере при трех значениях коллекторного напряжения $U_{\rm K1}$, $U_{\rm K2}$, $U_{\rm K3}$.



Рис. 5. Качественный вид зависимости $\tilde{U}_{\Im \mathsf{F}}(U_{\mathsf{K}})$ МБТ с локализацией тока в транзисторной структуре

При дефекте электрофизической природы зависимость переменной составляющей напряжения $\tilde{U}_{\Im 5}$ от коллекторного напряжения U_{κ} можно

$$\tilde{U}_{\Im \mathbf{b}}(U_{\mathrm{K}}) = \tilde{U}_{\Im \mathbf{b}}(0) \left[1 + \frac{b}{(1 - U_{\mathrm{K}}/U_{\mathrm{K}\Pi})^2} \right],$$
 (13)

где $\tilde{U}_{\Im b}(0)$ – амплитуда переменного напряжения на эмиттерном переходе при коллекторном напряжении $U_{\rm K}$, близком к нулю; *b* – параметр, зависящий от величины дефекта в структуре транзистора, как правило, *b* << 1.

В качестве $\tilde{U}_{\Im b}(0)$ принимается значение $\tilde{U}_{\Im b}$ при $U_{K0} \ll U_{K\Pi}$ на «плоском» участке характеристики $\tilde{U}_{\Im b}(U_{K})$, например при $U_{K0} = 5$ В. По значениям переменной составляющей напряжения на эмиттерном переходе $\tilde{U}_{\Im b}(U_{K1})$ и $\tilde{U}_{\Im b}(U_{K2})$ при двух коллекторных напряжениях U_{K1} и U_{K2} ($U_{K1} \ll U_{K2}$) вычисляются параметра: $a1 = \tilde{U}_{\Im b}(U_{K1})/\tilde{U}_{\Im b}(5$ В), и значение $U_{K\Pi}$ рассчитывается по формуле:

$$U_{\rm KJI} = \frac{U_{\rm K2} - mU_{\rm K1}}{1 - m},\tag{14}$$

где $m = \sqrt{(a1-1)/(a2-1)}$.

Относительная погрешность $\delta_{U_{K\Pi}}$ значения $U_{K\Pi}$, вычисленного по формуле (14), зависит от погрешности δ_a определения параметров *a*1 и *a*2, а также от того, насколько сильно эти параметры *a*1 и *a*2 отличаются от 1:

$$\delta_{U_{\rm KII}} \approx \frac{\delta_a}{2} \sqrt{\left(\frac{a1}{a1-1}\right)^2 + \left(\frac{a2}{a2-1}\right)^2} \,. \tag{15}$$

При использовании современных вольтметров несложно обеспечить относительную погрешность $\delta_{\tilde{U}_{\Im}}$ измерения \tilde{U}_{\Im} в переделах 0,5%, и относительная погрешность δ_a измерения параметров *a*1 и *a*2 не будет превышать 0,7 %, а суммарная методическая погрешность измерения $U_{K\Pi}$ даже изменении амплитуды \tilde{U}_{\Im} всего на 10–15 % во всем диапазоне изменения коллекторного напряжения не будет превышать 10%.

В случае дефекта теплофизической природы зависимость переменной составляющей напряжения $\tilde{U}_{\text{ЭБ}}$ от коллекторного напряжения U_{K} описывается формулой:

$$\widetilde{U}_{\Im \mathcal{F}}(U_{\mathrm{K}}) = \widetilde{U}_{\Im \mathcal{F}}(0) \cdot \left[c + \frac{d}{\left[1 - \left(U_{\mathrm{K}}/U_{\mathrm{K}\Pi} \right) \right]^2} \right], \tag{16}$$

где $c = 1 + \eta$; $d = [1 - (U_r / U_{\text{KЛ}})]\eta$.

Для нахождения трех неизвестных c, d и $U_{K\Pi}$ по результатам измерений $\tilde{U}_{\Im \overline{D}}$ при трех значениях коллекторного напряжения составим систему из трех уравнений:

$$g_i = c + \frac{d}{\left[1 - \left(U_{\text{K}i} / U_{\text{K}\Pi}\right)\right]^2};$$
(17)

где $g_i = \tilde{U}_{\Im \mathsf{F}}(U_{\mathsf{K}i}) / \tilde{U}_{\Im \mathsf{F}}(0)$.

Данную систему в общем случае можно решить численным методом. Для получения аналитического решения системы составим отношение двух разностей $g_2 - g_1$ и $g_3 - g_2$, в которых уже отсутствует одна неизвестная величина *с*:

$$\frac{(g_2 - g_1)}{(g_3 - g_2)} = \left[\frac{(U_{\rm K\Pi} - U_{\rm K1})^2 - (U_{\rm K\Pi} - U_{\rm K2})^2}{(U_{\rm K\Pi} - U_{\rm K2})^2 - (U_{\rm K\Pi} - U_{\rm K3})^2}\right] \frac{(U_{\rm K\Pi} - U_{\rm K3})^2}{(U_{\rm K\Pi} - U_{\rm K1})^2}.$$
(18)

Аналитическое решение (18) можно получить, если значения коллекторного напряжения выбрать эквидистантными $U_{K3} = U_{K2} + \Delta U_K = U_{K1} + 2\Delta U_K$. При этом величина приращения коллекторного напряжения ΔU_K , с одной стороны, должна быть достаточно

большой, чтобы обеспечить различие значений g_1 , g_2 и g_3 , заметно превышающее погрешность измерения $\tilde{U}_{\Im b}$, а с другой стороны, существенно (в несколько раз) меньше ожидаемого значения напряжения локализации $\Delta U_K \ll U_{K\Pi}$. В этом случае с учетом $\Delta U_K/U_{K\Pi} = v \ll 1$ приближенное решение (18) можно записать в виде

$$U_{\rm KJI} \approx U_{\rm KI} + \frac{2\Delta U_{\rm K}}{1 - \left(\frac{\beta}{1 + \nu}\right)},\tag{19}$$

где $\beta = \sqrt{\frac{g_2 - g_1}{g_3 - g_2}} \equiv \sqrt{\frac{\tilde{U}_{\Im \mathrm{F}}(U_{\mathrm{K2}}) - \tilde{U}_{\Im \mathrm{F}}(U_{\mathrm{K1}})}{\tilde{U}_{\Im \mathrm{F}}(U_{\mathrm{K3}}) - \tilde{U}_{\Im \mathrm{F}}(U_{\mathrm{K2}})}}.$

Заметим, что, поскольку в выражение для β входят только отношения g2-g1 и g2-g3, то $\tilde{U}_{\Im 5}(0)$ сокращается, и необходимость измерения этой величины отпадает.

Для методической погрешности определения $U_{\rm KЛ}$ по (19) получено следующее выражение:

$$\varepsilon_{U_{\rm KR}} \approx \left(\frac{2\beta}{1-\beta}\right) v^2.$$
 (20)

где значение параметра ν обычно не превышает 0,1; эта погрешность сильно возрастает при $\beta \rightarrow 1$, но уже при $\beta > 1,2$ не будет превышать 10%.

Поскольку изначально неизвестно, какой вид дефекта является преобладающим у конкретного образца МБТ, то в общем случае расчет напряжения локализации необходимо проводить по формулам (14) и (19) и для оценки качества МБТ принимать меньшее из полученных значений. Поскольку наиболее распространенными и опасными дефектами являются дефекты электрофизической природы, то для 90–95 % МБТ напряжение локализации может быть определено по формуле (14).

Схема устройства, реализующего способ, приведена на рис. 6, а эпюры токов и напряжений, поясняющие работу устройства – на рис. 7.

Устройство работает следующим образом. По сигналу «Запуск» устройство управления 2 вырабатывает управляющий импульс длительностью Тизм, который поступает на запускающие входы соответствующих устройств. В течение действия импульса управления источник тока 3 вырабатывает импульс постоянного эмиттерного тока (рис. 7, а). По сигналу управляющего импульса генератор линейно нарастающего напряжения 4 вырабатывает напряжение, изменяющееся по линейному закону (рис. 7, б) с максимальным значением $U_{\rm KM}$, которое поступает на один из входов сумматора-усилителя мощности 6, а генератор синусоидального напряжения 5 начинает вырабатывать переменное напряжение (рис. 7, в), которое поступает на второй вход сумматора-усилителя мощности 6. С выхода сумматора-усилителя мощности 6 усиленное суммарное напряжение (рис. 7, г) поступает на коллектор контролируемого МБТ. Переменное напряжение с эмиттера контролируемого МБТ через разделительный конденсатор 8 поступает на вход регистратора 7, который по сигналу устройства управления 2 регистрирует три значения $\tilde{U}_{ ext{3}\text{F0}}(U_{K0}), \ \tilde{U}_{ ext{3}\text{F1}}(U_{K1}),$ $\widetilde{U}_{\Im 552}(U_{K2})$ амплитуды переменной составляющей напряжения на эмиттерном переходе контролируемого МБТ (рис. 7, д) при трех значениях коллекторного напряжения U_{K0}, $U_{\rm K1}, U_{\rm K2}$ и передает эти значения в вычислитель 9, который вычисляет искомое значение напряжения локализации тока по формуле (15). Если амплитуда ${ ilde U}_{ o {
m B}}$ не зависит от коллекторного напряжения при выбранном $U_{\rm KM}$, параметры a1 и a2 близки к единице $a1 \approx a2 \approx 1$ и по результатам этих измерений значение U_{КЛ} будет стремиться к бесконечности.



Рис. 6. Структурная схема устройства, реализующего способ измерения напряжения шнурования тока при трех коллекторных напряжениях: 1 – колодка с клеммами для подключения контролируемого транзистора, 2 – устройство управления, 3 – источник тока, 4 – генератор линейно нарастающего напряжения, 5 – генератор синусоидального напряжения, 6 – сумматор-усилитель мощности, 7 – регистратор, 8 – разделительный конденсатор



Рис. 7. Эпюры токов и напряжений, поясняющие работу устройства

Для снижения вероятности попадания контролируемого МБТ в опасный режим предложены способ и устройство измерения напряжения шнурования тока в МБТ по патенту №2616871 РФ, в котором измеряется не амплитуда $\tilde{U}_{\Im 5}$ контролируемого МБТ при заданных значениях напряжения на коллекторе, а значения напряжения U_{K1} и U_{K2} на коллекторе контролируемого МБТ, при которых амплитуда $\tilde{U}_{\Im 5}(t)$ становиться равной $(1+k1)\tilde{U}_{\Im 5}(0)$ и $(1+k2)\tilde{U}_{\Im 5}(0)$, соответственно, где k1 и k2 – заданные коэффициенты, причем k2 > k1, $\tilde{U}_{\Im 5}(0)$ – начальное значение этой амплитуды при напряжении на коллекторе, близком к нулю (рис. 8), и напряжение шнурования тока вычисляют по формуле:

$$U_{KT} = \frac{qU_{K2} - U_{K1}}{q - 1},$$
(21)



гис. 8. Качественный вид зависимости $U_{\Im 56}(U_K)$ мыт с локализацией тока в транзисторной структуре и заданными уровнями амплитуды

Методическая погрешность определения $U_{\rm KR}$ по (21) определяется значением коэффициента q и относительной погрешностью δ_u измерения напряжений U_{K1} и

 $U_{K2}: \delta_{U_{KR}} \approx \delta_u \frac{\sqrt{q^2 + 1}}{(q - 1)}$ и в пределе при $q \to \infty$ стремиться к δ_U , которая, как отмечалось, не превышает 0,5%, и уже при q > 1,2 методическая погрешность измерения U_{KR} этим способом в несколько раз меньше, чем способом, описанным выше.

Для реализации данного способа разработан алгоритм и блок обработки данных.

Структурная схема устройства, реализующего способ, приведена на рис. 9, а эпюры токов и напряжений, поясняющие способ – на рис. 10.



Рис. 9. Структурная схема устройства, реализующего способ измерения $U_{\rm KJI}$ по заданным уровням: 1– колодка для подключения контролируемого транзистора; 2 – устройство управления; 3 – источник тока; 4 – генератор линейно нарастающего напряжения; 5 – генератор низкой частоты; 6 – сумматор-усилитель мощности; 7 – разделительный конденсатор; 8 – устройство выделения огибающей; 9 – резистивный делитель, содержащий три резистора *R*1, *R*2 и *R*3; 10 – устройство выборки и хранения; 11 и 12 – два устройства сравнения; 13 – регистратор; 14 – вычислитель



Рис. 10. Эпюры сигналов, поясняющие принцип работы устройства

В **третьей главе** описана экспериментальная установка для исследования теплоэлектрических параметров мощных ВЧ и СВЧ-транзисторов (УИТЭП-1М) и представлены результаты апробации разработанных способов измерения *U*_{КЛ}.

Структурная схема установки УИТЭП-1М приведена на рис. 11. В ее состав входят: генератор низкой частоты (ГНЧ), генератор линейно нарастающего напряжения (ГЛНН), сумматор, усилитель мощности со схемой защиты, генератор стабильного тока (ГСТ), усилитель низкой частоты (УНЧ), блок управления, блок контроля высокочастотной генерации и блок питания. Установка работает в комплексе с цифровым осциллографом RIGOL DS1052E и платой сбора данных.

Проверка способа измерения $U_{\rm KЛ}$ по амплитуде переменной составляющей напряжения на эмиттерном переходе, измеренной при трех значениях коллекторного напряжения, проводилась на МБТ типа КТ903, которые могут некоторое время выдерживать режим «горячего пятна» без катастрофического отказа. Зависимости $\tilde{U}_{3\rm E}(U_{\rm K})$ для нескольких образцов МБТ при $I_{\rm P} = 0,5$ A, $U_{\rm KM} = 50$ B, амплитуде переменной составляющей коллекторного напряжения 1 B, частоте 50 Гц и времени нарастания $U_{\rm K} t_{\rm H} = 1$ с приведены на рис.12.



Рис. 11. Установка УИТЭП-1М: структурная схема

Примерно у 30% исследованных приборов наблюдается режим «горячего пятна», которому на зависимости $\tilde{U}_{\Im E}(U_K)$ соответствует ярко выраженный максимум. Коллекторное напряжение, соответствующее максимуму характеристики $\tilde{U}_{\Im E}(U_K)$, принималось за напряжение локализации тока. Для нескольких образцов с явно выраженным шнурованием тока напряжение локализации рассчитывалось по измеренным значениям на начальном участке зависимостей $\tilde{U}_{\Im E}(U_K)$. Результаты расчета приведены в таблице.





б. №454

Рис.12. Зависимости $\tilde{U}_{\Im b}(U_{K})$ транзисторов КТ903А при эмиттерном токе 0,5 А и U_{KM} = 50 В: *а* – без образования «горячего пятна»; *б* – с образованием «горячего пятна»

~								
измеренные и рассчитанные по зависимостям $ ilde{U}_{ m 25}ig(U_{ m K}ig)$ при токе 0,5 А								
Таблица 1 – Значения напряжения локализации тока транзисторов КТ903А,								

Номер МБТ	Расчетное значение U _{кл} , B,	Значение $U_{\rm KJ}^{\rm M}$ по максимуму $\tilde{U}_{\rm 2F}(U_{\rm K}), { m B}$	Абсолютная разница значений $\Delta U = U_{KJ} - U_{KJ}^{\mu}$, В	Относительная разница значений $\xi = (\Delta U/U_{\rm KJ}^{\rm M}) \cdot 100\%$
281	44,8	43,0	1,8	4,3
271	45,4	43,5	1,9	4,6
243	38,4	36,4	2,0	5,7
316	36,7	36,0	0,7	2,0
452	38,3	37,0	1,3	3,5
737	∞	∞	-	-
418	∞	∞	-	-
454	48,6	47,8	0,8	1,7
264	45,0	42,8	2,2	5,0

Значения $U_{\rm KЛ}$, рассчитанные по измеренным значениям зависимости $\tilde{U}_{\rm 35}(U_{\rm K})$, оказались несколько больше, чем наблюдаемые по максимуму на характеристиках $\tilde{U}_{\rm 35}(U_{\rm K})$. Это различие не превышает 6 %, что для производственного контроля и разбраковки МБТ по устойчивости к шнурованию тока вполне приемлемо. Более того, способ позволяет задать в качестве отбраковочного уровня коллекторное напряжение, при котором крутизна характеристики $\tilde{U}_{\rm 35}(U_{\rm K})$, превышает некоторое критическое значение.

Сравнение косвенного и прямого способов измерений $U_{\rm KЛ}$ проводились на выборке транзисторов типа КТ903А в количестве 20 шт. при $U_{\rm KM} = 50$ В, токе эмиттера 0,7А, времени нарастания $U_{\rm K}$ $t_{\rm H} = 2,5$ с. Температура кристалла контролировалась с помощью ИК микроскопа OPTOTHERM. Предварительно у транзисторов были спилены крышки корпуса, а сами кристаллы очищены от компаунда.



Рис.14. Осциллограмма (а) зависимости $\tilde{U}_{\Im E}(U_K)$ и фотография (б) экрана ИК микроскопа для транзистора КТ903А №7

На рис. 15. приведены графики зависимостей напряжения шнурования тока от температуры корпуса $U_{\text{KЛ}}(T_{\text{K}})$ нескольких образцов транзисторов типа КТ903А, измеренные при $U_{\text{Kmax}} = 54$ В, $\Omega = 40$ Гц, эмиттерном токе 0,8 А и длительности импульса 1,5 с в диапазоне температур от -60 °C до +90 °C.



Рис. 15. Зависимости напряжения шнурования тока от температуры корпуса транзисторов типа КТ903А при эмиттерном токе 0,8 А

Из графиков видно, что с увеличением температуры корпуса напряжение $U_{K\Pi}$ шнурования тока сначала несколько снижается, а затем увеличивается, то есть существует минимальное напряжения $U_{K\Pi min}$ шнурования тока при некоторой температуре T_{KP} корпуса транзистора. Это минимальное напряжение локализации тока и определяет реальное максимально допустимое коллекторное напряжение транзистора.

В четвертой главе приведены выборочные распределения МБТ по тепловым параметрам и результаты исследований влияния теплоэлектрических параметров МБТ на характеристики усилительных каскадов различных классов.

Интегральные распределения 90 штук транзисторов типа КТ903А по величине напряжения $U_{KЛI}$ и $U_{KЛ2}$ шнурования тока, измеренного при двух токах $I_{K1} = 0.5A$ и $I_{K2} = 0.8A$, соответственно, приведены на рис. 16.



Рис. 16. Интегральные распределения транзисторов КТ903A по величине напряжения локализации тока: $1 - I_K = 0.8 \text{ A}$; $2 - I_K = 0.5 \text{ A}$

С увеличением тока, при котором измерялось напряжение шнурования, характер распределения транзисторов по величине $U_{K\!\Pi}$ изменяется: абсолютный разброс приборов по величине $U_{K\!\Pi}$ увеличивается.

При коллекторном токе $I_{KI} = 0,5$ А выборочное среднее значение $\overline{U}_{KЛ}$ напряжения локализации составило $\overline{U}_{KЛ} \approx 55$ В и среднеквадратическое отклонение среднего $\sigma_{\overline{U}_{KЛ}} \approx 6$ В, а при $I_{KI} = 0,8$ А $- \overline{U}_{KЛ} \approx 34$ В и $\sigma_{\overline{U}_{KЛ}} \approx 3$ В, соответственно.

Абсолютный разброс тепловых сопротивлений МБТ возрастает с увеличением коллекторного напряжения, а напряжения шнурования – с уменьшением коллекторного тока, что объясняется определяющим влиянием технологического разброса распределенных (стабилизирующих) сопротивлений структуры: с ростом тока их стабилизирующее действие возрастает и их технологический разброс проявляется слабее.

Для исследования связи уровня второй гармоники в транзисторных каскадах класса A с тепловыми параметрами транзисторов была собрана экспериментальная установка по схеме на рис. 17. Испытуемый транзистор VT1 включался по схеме с общим эмиттером и размещался на радиаторе с площадью рассеяния 100 см² с принудительным воздушным охлаждением. Величина коллекторного тока задавалась источником смещения $E_{\rm b}$ и переменным резистором R1 и измерялась встроенным амперметром источника $E_{\rm K}$ питания каскада. В качестве нагрузки R2 использовался реостат с полным сопротивлением 50 Ом. В базу транзистора через разделительный конденсатор C1 подавался синусоидальный сигнал. Уровень второй гармоники измерялся селективным вольтметром V, как на входе транзистора, так и на сопротивлении нагрузки

Зависимости уровня второй гармоники каскада на транзисторах КТ805Б от коллекторного напряжения $U_{\rm K}$ на частоте 30 Гц при амплитуде входного сигнала 1,5 В представлены на рис.18.



Рис. 17. Структурная схема экспериментальной установки: Г- НЧ генератор; V – селективный вольтметр; Е_Б и Е_К



Рис. 18. Зависимость уровня второй гармоники каскада на транзисторах КТ805Б от коллекторного напряжения U_K : $N_{2}4 - R_{TII-K} = 6,1$ K/BT; $N_{2}7 - R_{TII-K} = 5,6$ K/BT; $N_{2}8 - R_{TII-K} = 5$ K/BT

Из графиков видно: чем больше тепловое сопротивление, тем больше и уровень второй гармоники при $U_{\rm K} > 40$ В. При этом у образца №4 наблюдался существенный рост второй гармоники при $U_{\rm K} > 38$ В, что обусловлено локализацией тока в транзисторной структуре. Аналогичные эффекты были выявлены и в транзисторных каскадах на СВЧ транзисторах типа КТ904Б. Резкий рост уровня второй гармоники в этих каскадах при коллекторном токе 0,3 А наблюдался при $U_{\rm K} > 18-20$ В.

В дифференциальных каскадах (ДК) на биполярных транзисторах (рис. 19) при подаче на вход ДК гармонического сигнала $\Delta U = U_1 - U_2 = U_m \sin \omega t$ переменная составляющая мощности P_{im} приводит к появлению переменной составляющей температуры, амплитуда которой T_{im} в результате действия ТОС с коэффициентом $K_T \approx -2,0$ мВ/К на входах транзистора создает дифференциальный сигнал

$$\Delta U_{\rm m} = K_T \Delta \widetilde{T}_{1,2} , \qquad (22)$$

который приводит к дополнительным линейным искажениям.



Рис. 19 Схема дифференциального каскада (а) и его эквивалентная тепловая схема (б)

Коэффициент линейных искажений, возникающих в дифференциальном каскаде из-за различия тепловых сопротивлений на низкой частоте, будет равен:

$$K_{JTT} = \Delta R_T K_T \sqrt{\left[(R_{T1} + R_{T2}) \cdot 2b\theta + (1 - 2\theta) \right]^2 E_K^2 I_m^2 + P_m^2} / U_m =$$

= $\Delta R_T K_T K_V \sqrt{\left[(R_{T1} + R_{T2}) \cdot 2b\theta + (1 - 2\theta) \right]^2 E_K^2 + R_K^2 I_m^2} / R_K,$ (23)

где Ку-коэффициент усиления дифференциального сигнала.

На высоких частотах $\omega >> \tau_{Ti}$ линейные искажения этой природы будут исчезать в результате инерционности тепловых процессов. Для расчета искажений тепловой природы в диапазоне средних частот необходимо учитывать частотную зависимость теплового импеданса.

В двухтактных усилителях класса В различное смещение рабочих точек БТ обусловлено разностью средних температур транзисторов $\overline{\Delta T}_{12} = (E_K I_m / \pi) \Delta R_T$. Это смещение приводит к различию крутизны сквозных входных характеристик S_1 и S_2 . По оценке методом трех ординат, полагая в первом приближении, что разность крутизны пропорциональна разности температур $\Delta S = K_S \overline{\Delta T}_{12}$ коэффициент гармоник можно записать в виде

$$K_{\Gamma} = K_{S} E_{K} I_{m} (R_{T1} - R_{T2}) / 4\pi (S_{1} + S_{2}).$$
(24)

Приведенные оценки показывают, что при изготовлении прецизионной аппаратуры необходимо подбирать МБТ не только по электрическим, но и по тепловым параметрам.

В заключении представлены основные результаты работы:

1. Разработаны компьютерная и аналитическая теплоэлектрические модели токораспределения в структурах МБТ с дефектами электрофизической и теплофизической природы. Показано, что коэффициент внутренней обратной связи по напряжению МБТ нелинейно растет с увеличением коллекторного напряжения, при этом крутизна этой зависимости определяется видом и размером дефекта.

2. Ha развитой неразрушающий основе модели разработан способ И автоматизированное устройство измерения напряжения UKЛ шнурования тока МБТ по значениям характеристики ${{ ilde U}_{{}_{
m F}}}(U_{{}_{
m K}})$, измеренным при трех значениях коллекторного напряжения без введения контролируемого транзистора в режим «горячего пятна». Показано, что методическая погрешность способа уменьшается с ростом кругизны и не превышает 10 % при относительной кругизне характеристики $\tilde{U}_{25}(U_{\rm K})$ порядка 5% в заданном диапазоне коллекторного напряжения. Значения Uкл, полученные предложенным способом для транзисторов типа КТ903А, отличаются от значений, полученных известным способом, не более, чем на 6%.

3. Разработан неразрушающий способ, автоматизированное устройство и алгоритм определения $U_{\rm KЛ}$ по значениям коллекторного напряжения, измеренным при двух значениях коэффициентов превышения характеристики $\tilde{U}_{\rm 35}(U_{\rm K})$ ее начального уровня. Показано, что методическая погрешность этого способа может быть снижена по сравнению с погрешностью способа по п. 2 в 3–5 раз путем выбора указанных коэффициентов. Способ и алгоритм апробированы на нескольких типах мощных биполярных СВЧ транзисторов.

4. Модернизирована экспериментальная автоматизированная установка для измерения теплоэлектрических характеристик мощных биполярных ВЧ и СВЧ транзисторов, в части автоматизации обработки измерительной информации и расширения диапазонов задания режима по току от 0,1 до 1,5 A, по напряжению от 5 до 80 B и длительности тестового от 0,5 до 2,5 с.

5. Сравнение результатов косвенного измерения напряжения U_{KЛ} шнурования тока МБТ разработанными способами с результатами измерения локальной температуры

транзисторной структуры с помощью ИК-микроскопа ОРТОТНЕRМ показали хорошее совпадение.

6. Впервые получены зависимости напряжения шнурования тока от температуры корпуса в диапазоне температур от – 60 до +90 °С. Показано, что с увеличением температуры корпуса транзистора напряжение $U_{K/I}$ шнурования тока транзисторов КТ903 снижается, а при дальнейшем увеличении температуры увеличивается, то есть некоторой температуре T_{KP} корпуса транзистора существует минимальное значение напряжения $U_{K/Imin}$ шнурования тока. На основе полученных результатов может быть разработана методика отбраковки потенциально ненадёжных мощных биполярных ВЧ и СВЧ транзисторов по минимальному напряжению $U_{K/Imin}$ шнурования тока в приборных структурах.

7. Получены выборочные распределения мощных биполярных транзисторов по значениям теплового сопротивления и напряжения шнурования тока.

8. Теоретически показано и экспериментально подтверждено, что нелинейность транзисторных усилителей класса А возрастает при приближении рабочей точки транзистора к границе ОБР.

Список опубликованных работ по теме диссертации

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК

1. Сергеев, В. А. Компьютерное моделирование неизотермического токораспределения в симметричных биполярных транзисторных структурах с дефектами / В.А. Сергеев, О.А. Дулов, А., А. Куликов // Известия вузов. Электроника. – 2008. – №5. – С. 84–86.

2. Сергеев, В. А. Контроль однородности токораспределения в биполярных транзисторах по зависимости коэффициента внутренней обратной связи от коллекторного напряжения / В. А. Сергеев, О.А. Дулов, А. А. Куликов // Известия вузов. Электроника. –2009. – №2. – С.10–16.

3. Sergeev, V. A. Monitoring of the Current-Distribution Uniformity in Bipolar Transistors from the dependence of Internal-Feedback Factor on Collector Voltage / V. A. Sergeev, O.A. Dulov, A.A. Kulikov // Semiconductors. – 2010. – Vol. 44, No. 13. – pp. 1675-1679.

4. Сергеев, В.А. Неразрушающий метод определения напряжения шнурования тока в мощных ВЧ и СВЧ биполярных транзисторах / В.А. Сергеев, А.А. Куликов // Известия вузов. Электроника. – 2014. – №4. – С. 46-53.

5. Sergeev, V. A. Nondestructive Method for Determining the Voltage of Current Pinching in Powerful Radiofrequency and Microwave Bipolar Transistors / V. A. Sergeev, A.A. Kulikov // Russian Microelectronics. – 2015.- №7. – C. 473-477.

6. Сергеев, В. А. Установка для измерения напряжения шнурования тока в структурах мощных ВЧ- и СВЧ биполярных транзисторов / В.А. Сергеев, А.А. Куликов, Р.Г. Тарасов, Я.Г. Тетенькин // Автоматизация процессов управления. – 2017. – №3. - С. 43-51.

Патенты и авторские свидетельства

7. Патент №2537519 РФ МКИ G01R 31/26.Способ определения напряжения локализации тока в мощных биполярных транзисторах / Сергеев В.А., Дулов О.А., Куликов А.А. – Заявл. 2012009436 от 14.09.2012. – опубл. 21.04.2013, Бюл. 17.

8. Патент №2616871 РФ МКИ G01R 31/26.Способ определения напряжения локализации тока в мощных биполярных транзисторах / В.А. Сергеев, А.А. Куликов – Заявл. 2012009436 от 14.09.2013. – опубл. 21.01.2015, Бюл. 2.

Основные публикации в других изданиях

9. Козликова, И.С. Токовые зависмости теплового сопротивления переход-корпус мощных ВЧ транзисторов/ И.С. Козликова, С.О. Мисбахова, А.А. Куликов // Актуальные проблемы физической и функциональной электроники : материалы 19-й Всероссийской молодежной научной школы-семинара. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – С. 77–78.

10. Куликов, А.А. Теплофизические характеристики мощных транзисторов при гармонической модуляции греющей мощности // Актуальные проблемы физической и функциональной электроники: материалы 9-й региональной научной школы-семинара. – Ульяновск : УлГТУ, 2006. – С. 21 – 22.

11. Куликов, А.А. Блок генераторов для установки измерения теплофизических параметров мощных транзисторов / А.А. Куликов, О.А. Дулов // Актуальные проблемы физической и функциональной электроники: материалы 9-й региональной научной школысеминара. – Ульяновск : УлГТУ, 2006. – С. 26 – 27.

12. Куликов А.А. Исследование теплофизических параметров мощных биполярных транзисторов с применением программы Electronics Workbench / А.А. Куликов, О.А. Дулов // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: XIII-я Междунар. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов: тезисы докл. В 3 т. Т.1. – М.: МЭИ, 2007. – С. 277–278.

13. Куликов, А.А. Разбаланс токов тепловой природы в дифференциальных транзисторных каскадах / А.А. Куликов // Актуальные проблемы физической и функциональной электроники : материалы 11-й региональной научной школы-семинара. – Ульяновск : Ул-ГТУ, 2008. – С. 39–41.

14. Куликов, А.А. Контроль качества мощных биполярных транзисторов по малосигнальным параметрам / А.А. Куликов, О.А. Дулов // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: 14-я Междунар. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов: Тезисы докл. В 3 т. Т.1. – М.: Издательский дом МЭИ, 2008. – С. 232–234.

15. Куликов, А.А. Установка для измерения теплофизических параметров мощных биполярных транзисторов / А.А. Куликов, В.А. Сергеев // Актуальные проблемы физической и функциональной электроники. Материалы 12-й региональной научной школысеминара - в 2 Т. Т1 Ульяновск : УлГТУ, 2009. – С.60.

16. Куликов, А.А. Идентификация искажений тепловой природы в симметричных транзисторных каскадах / А.А. Куликов, В.А. Сергеев // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика: 14-я Междунар. науч.-техн. конф. студентов и аспирантов: Тез. докл. В 3 т. Т.1. – М. : Издательский дом МЭИ. – 2010. – С. 283–284.

17. Куликов, А.А. Аппаратно-программный комплекс для измерения напряжения локализации мощных биполярных транзисторов / А.А. Куликов // Актуальные проблемы физической и функциональной электроники. Материалы 15-й региональной научной школысеминара. Ульяновск : УлГТУ, 2012. – С. 38–39.

18. Куликов, А.А. Способ определения напряжения локализации тока в мощных биполярных транзисторах по трем значениям U_{кб} / А.А. Куликов, В.А. Сергеев // Актуальные проблемы физической и функциональной электроники: материалы 18-й Всероссийской молодежной научной школы-семинара. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – С. 56-57

19. Куликов, А.А. Контроль качества мощных СВЧ биполярных транзисторов по величине тепловых сопротивлений, измеренных в диодных режимах / А.А. Куликов, В.А. Сергеев // Актуальные проблемы физической и функциональной электроники : материалы 18-й Всероссийской молодежной научной школы-семинара. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – С. 58-59.

20. Куликов, А.А. Сравнительный анализ результатов измерения параметров шнурования тока в мощных ВЧ и СВЧ биполярных транзисторах прямым и косвенным методом / А.А. Куликов, В.А. Сергеев // Актуальные проблемы физической и функциональной электроники : материалы 19-й Всероссийской молодежной научной школы-семинара. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – С. 77–78.

21. Куликов, А.А. Влияние материала подложки на тепловые характеристики бескорпусных мощных биполярных транзисторов в статическом режиме / А.А. Куликов, В.А. Сергеев // Актуальные проблемы физической и функциональной электроники : материалы 19-й Всероссийской молодежной научной школы-семинара. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – С. 58–59.

22. Куликов, А.А. Автоматизированный неразрушающий контроль напряжения шнурования тока в мощных биполярных СВЧ транзисторах / А.А. Куликов, А.И. Ишелев // Актуальные проблемы физической и функциональной электроники: материалы 19-й Всероссийской молодежной научной школы-семинара. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – С. 170–171.

23. Сергеев, В.А. Искажения тепловой природы в транзисторных усилителях с симметричным включением транзисторов / В.А. Сергеев, А.А. Куликов // Тезисы докладов НТК ППС УлГТУ «Вузовская наука – производству». - Ульяновск: УлГТУ – 2009. – С. 100.

24. Сергеев, В.А. Зависимость напряжения локализации тока в структурах мощных биполярных СВЧ-транзисторов от температуры / В.А. Сергеев, А.А. Куликов // Наноэлектроника, нанофотоника и нелинейная физика: Тез. докл. VII Всероссийской конф. молодых ученых. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2012. – С. 131–132.

25. Сергеев, В. А. Косвенный метод оценки параметров «горячих пятен» в мощных биполярных транзисторах / В.А. Сергеев, А.А. Куликов // Радиоэлектронная техника : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. В. А. Сергеева. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – С. 66–72

26. Сергеев В.А. Выборочные распределения мощных биполярных транзисторов по теплофизическим параметрам / В.А. Сергеев, А.А. Куликов // Современные проблемы создания и эксплуатации радиотехнических систем: сборник научных трудов восьмой Всероссийской научно-практической конференции (с участием стран СНГ), Ульяновск, 1-2 июля 2013 г. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – С. 211–213.

27. Сергеев, В.А. Установка для измерения напряжения шнурования тока в структурах мощных ВЧ и СВЧ биполярных транзисторов / В.А. Сергеев, А.А. Куликов // Материалы Международной научно-технической конференции, 1 – 5 декабря 2015 г. INTERMATIC-2015. – М. : МИРЭА. – 2015. – С. 222–223.

28. Сергеев, В.А. Искажения тепловой природы в транзисторных каскадах класса А на мощных биполярных ВЧ и СВЧ транзисторах / В.А. Сергеев, А.А. Куликов // Наноэлектроника, нанофотоника и нелинейная физика: тезисы докладов IX Всеросс. конф. молодых ученых. – Саратов : Техно-Декор, 2015. – С.73–74.

29. Сергеев, В.А. Установка для измерения напряжения шнурования тока в структурах мощных ВЧ и СВЧ биполярных транзисторов / В.А. Сергеев, О.А. Дулов, А.А. Куликов // Современные проблемы проектирования, производства и эксплуатации радиотехнических систем: сб. науч. тр. 9-й Всеросс. научно-практич. конференции (с участием стран СНГ). – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – С. 173–176.

30. Сергеев, В.А. Установка для измерения напряжения шнурования тока в структурах мощных ВЧ- и СВЧ биполярных транзисторов / В.А. Сергеев, А.А. Куликов, Р.Г. Тарасов // Актуальные проблемы и перспективы развития радиотехнических и инфокоммуникационных систем : сб. науч. тр. III Международной НПК РАДИОИНФОКОМ-2017»; в 2-х частях, Ч1. – М.: МИРЭА, 2017. – С. 529–533.

Куликов Александр Александрович

Неразрушающие способы и средства измерения напряжения шнурования тока в мощных биполярных ВЧ и СВЧ-транзисторах

Автореферат

Подписано в печать .10.2018. Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 1,17. Тираж 120 экз. Заказ ____

ИПК «Венец» УлГТУ, 432027, г. Ульяновск, Северный Венец, 32.